電磁膜厚計

試験体を損傷することなく膜厚測定する装置

[型式]

(株) サンコウ電子研究所 SME-1

[仕様]

電磁式(測定範囲) $0\sim3mm$ 、 (精度) $\pm1\mu$ m または、指示値の $\pm2\%$ 渦電流式 (測定範囲) $0\sim1mm$ 、 (精度) $\pm1\mu$ m または、指示値の $\pm2\%$

[設置年度]

1996年度(平成8年度)



O 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話(084-931-2402)でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。